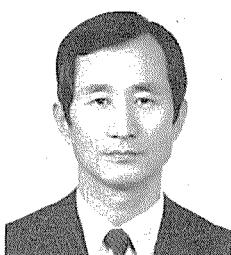


半導體產業  
育成을 위한  
對政府建議



柳 遠 榮

韓國電子(株) 社長

첨단기술의  
대명사로 불리는  
반도체산업의 기술경쟁은  
美日兩大國에서 격전을 벌이면서  
선진국간에 전 산업으로 확산되고 있다.  
知識集約型이며 급속한 기술혁신의  
특성으로 국가 차원의 정책지원,  
產·學의 긴밀한 협력체제가  
절실히 요구되는 국가적  
첨단산업이라 하겠다.

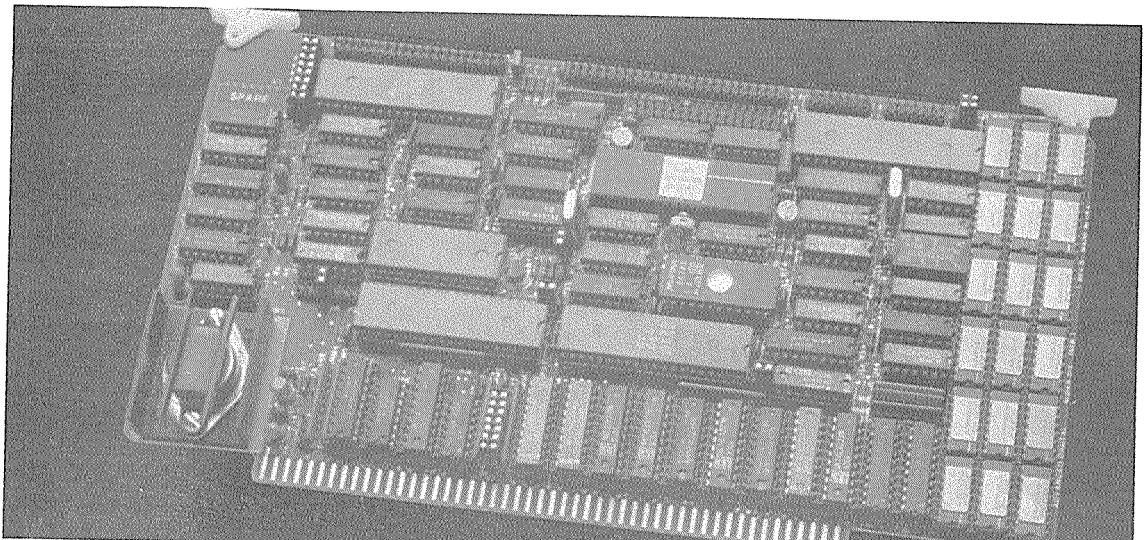
## 1. 序 言

世界는 바야흐로 치열한 技術競爭의 시대에 접어들었다. 技術競爭에 있어서의 落後는 곧 國際社會에서의 落後로 技術開發力이 곧 國家發展의 關鍵으로 등장함에 따라 美·日을 비롯한 技術先進國間에 있어서는 물론 韓國을 포함한 開發途上國間에 있어 尖端技術의 開發競爭은 날로 치열해지고 있다. 이러한 狀況에 적극 대처하기 위해 우리나라에서도 80年代 들어서면서 技術立國의 意志를 표현하고 이를 위한 政策을 강력히 추진하여 왔으며 특히 올해를 「技術革新의 해」로設定하고 技術立國의 실현을 위한 政策적인 지원과 技術開發을 위한 환경 조성에 힘을 쏟고 있다.

이러한 尖端技術產業 중에서도 半導體 產業은 그 응용 범위가 全產業에 확산되는 추세에 있고 高附加價值와 高率成長을 示顯하고 있는 최첨단 技術製品으로 尖端技術의 代名詞로 지정되고 있다. 美·日을 비롯한 先進國들이 半導體戰爭을 방불케 할 정도로 技術開發에 격전을 벌이면서 半導體 保護法案을 다투어立法化하고 있는 것은 그만큼 市場性이 높고 全產業 발전에 미치는 효과가 크기 때문이다. 그러나 半導體 產業은 지금 까지의 技術의 進步過程에서 나타난 몇 가지의 현저한 特성을 가지고 있다.

첫째로, 半導體 產業은 裝置 產業으로 莫大한設備投資를 필요로 한다. 製造工程이 복잡한데다 集積度가 향상됨에 따라 設備投資의 규모는 더욱 巨大화하는 경향을 보이고 있다. 이 때문에 賣出額에 대한 設備投資比率은 20% 정도로他產業에 비해 대단히 높다.

둘째로, 知識集約型 產業으로 研究開發分野가 電子工學을 비롯 物理, 機械, 電氣, 化工, 材料工學, 시스템工學 등 광범위하게 미치고 있어 研究開發投資 또한 막대하다. 賣出額對比 研究開發費의 비율이 우리나라의 경우는 정확한 통계가 나와 있지 않으나 日本의 경우 全產業 평균



반도체 산업은 빈약한 물적자원, 풍부한 인적자원을 가진 우리에게는 가장 적합한 산업이다.

1.5%, 電氣・機械 3.6%에 비해 IC 산업은 14.6%로 대단히 높다.

세째로, 技術革新의 속도가 대단히 빠르며 製品의 라이프 사이클 또한 매우 짧다. 64KD 램을 예로 들면 발표된 후 4년 만에 쇠퇴기에 접어들고 있다. 바꿔 말하면 이는 4년 이내에 量產體制를 갖추고 이익을 확보해야 한다는 것이다.

앞으로 技術의 진보는 더욱 빨라지고 製品의 라이프 사이클도 더욱 짧아 질 전망이다.

네째로, 半導體 산업은 量產體制가 대단히 중요한 산업이다. 生產量이 2倍가 되면 28%의 原價引下가 가능하다는 결과가 나와 있다. 早期에 量產體制를 확립함으로써 價格引下를 실현할 수 있고 마켓 쉐어를 높일 수 있는 산업이다. '79年開發當時 2萬円이었던 64KD 램이 '85年 2月에는 400円대로 떨어지고 있으니 실제로 놀라운 일이다.

이러한 半導體 산업의 특성 때문에 몇몇의 民間企業體의 힘만으로 半導體 산업을 발전시키는데는 한계가 있으며 國家的 次元에서의 정책적인 支援과 產・學의 긴밀한 協助體制 없이는 發展을 기대하기 어려운 산업이라 할 수 있다. 더구나 美・日의 先進國에 비해 技術적으로 뒤떨어져 있고 資本蓄積面에 있어서도 약한 우리의 현실에서는 보다 강력한 政策的 支援이 요청되는 산업이다.

이러한 연유에서 政府로서도 半導體 산업을 육

성키 위해 金融, 租稅 등을 비롯한 支援施策을 운영하여 왔으나 民間企業體의 입장에서 볼 때 미흡한 점이 없지 않다. 本稿에서는 이러한 側面에서 諸般 支援施策을 중심으로 한 對政府建議事項을 간략히 언급하고자 한다.

## 2. 현행 技術開發支援制度 内容과 改善 방향

80年代에 들어오면서 政府에서는 企業의 技術開發을 촉진하기 위한 金融, 租稅上의 產業技術支援制度의 개선에 주력하며 일단 制度的인 面에서는 정착이 되었으나 内容面에 있어 企業의 技術開發을 촉진시키기에는 아직도 미흡한 점이 많다고 본다. 현행의 支援制度의 현황을 정리해 보면 다음과 같다.(表 1)

### 1) 財政, 金融上의 支援

#### ① 特定研究開發事業을 통한 政府出捐金 支援制度

資金上의 支援制度로는 核心產業 技術의 중점 개발을 위해 特定研究開發事業에 대한 政府出捐金 支援制度가 81年度에 신설되어 年度別 研究課題를 선정하여 同事業에 참여하는 企業附設研究所 및 產業技術研究組合에 대해 政府出捐金을 지급하고 있으나 그 규모는 '82年度 133억 원, '83, '84年度 각각 220억 원, '85年度 300억 원을 계획하고 있으며 支援 비율에 있어서도 大企業

表 1. 支援手段別・段階別 支援制度 現況

段階別 支援手段別	研究開発段階	企業化段階	市場進出段階
1) 資金	• 研究開発費融資 및 補助	• 新技術企業化投・融資	
2) 租税	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 技術開發準備金制度</li> <li>• 技術 및 人力開發費稅額控除制度</li> <li>• 企業附設研究所用 不動產에 대한 地方稅 免除制度</li> <li>• 研究用 物品의 關稅輕減 制度</li> <li>• 研究用 見品의 特消稅 免除</li> <li>• 外國人 技術者에 대한 所得稅 免除制度</li> <li>• 技術導入 代價에 대한 租稅減免</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 新技術企業化 投資稅額控除 또는 特別減價償却制度</li> </ul> <p style="text-align: center;">• 左              同</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 技術開發先導物品에 대한 特消稅 減免制度</li> <li>• 技術所得에 대한 租稅 減免</li> <li>• 技術用役事業所得控除</li> <li>• 左              同</li> </ul>
3) 政府購買	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 技術開發費의 原價反映</li> <li>• 新製品 開發者에 대한 入札 資格賦與</li> <li>• 品質・性能・效率을 重視하는 入札制度</li> </ul>
4) 其他	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 研究要員 兵役特例制度</li> <li>• 試驗研究用 施設 및 材料의 輸入 支援制度</li> </ul>	—	—

의 경우에는 총소요자금의 30%以下라는 條件으로 되어 있어 1個業體當 몇백억원의 研究開發投資를 계획하고 있는 半導體產業에는 큰 도움이 되지 못하는 실정이다. 金額規模面에서 대폭적인 增額이 요청되어 研究開發費 中 政府支援負擔比率을 현재의 上限線 策定에서 下限線 策定으로 改正함과 동시에 비율 또한 現物出資比率을 포함하여 再調整이 있어야 할 것으로 본다.

## ② 金融機關을 통한 金融資金 支援

企業化段階에서의 資金需要에 대처하기 위한 支援資金으로는 產業銀行, 中小企業銀行, 技術開發(株) 등 金融機關을 통하여 供給하고 있는 金融資金으로 '84年度의 1,490億원 규모에서 금년에는 1,976억원으로 대폭增加되었다고는 하나(表2) 半導體產業 하나만 두고 봐도 1個企業의 投資規模에 이르지 못하는 아쉬움이 있다. 半導體業體들이 최근들어 투자를 늘리고 있으나 전반적으로 技術開發投資에 필요한 財源不況 현상이 심각한 실정이다. 日本의 경우 半導體部門에 '84年度에 9,000억円의 投資가 이루어진 것으로 集計되고 있고 '85年度에도 1조円 규모의

investment가 이루어질 것으로 展望되고 있으며 國內半導體業界 또한 '85年度에는 작년과 같은 水準인 3,500억원 규모의 投資를 계획하고 있는 것으로 나타나고 있다. 半導體產業의 特性과 그 중요성을 고려하여 별도의 政策基金이 마련되어 金利面에 있어서도 一般貸出金利보다 低率의 金利를 적용한 정부재정에 의한 長期低利融資의 增大를 통해 投資財源을 造成하여 줄 강력한 정책적인 배려가 필요하다고 본다.

表 2. 金融機關을 통한 技術開發資金支援  
(단위: 억원)

	1984	1985
產業銀行	612	700
中小企業銀行	273	400
技術開發(株)	570	600
技術金融(株)	—	240
開發投資(株)	33	30
技術振興(株)	2	6
合計	1,490	1,976

## 2) 租税上의 支援

租稅減免規制法이 오는 '86年度에 그 時效가 만료됨에 따라 금년 중에 綜合稅制改編作業이

전면적으로 이루어질 것이 예상되는 바 그改編過程에서租稅支援의 최우선對象을半導體를비롯한尖端技術開發活動에둠으로써企業의技術開發投資의욕을지속시켜나감과동시에실질적인도움이될수있도록支援幅을확대하고事後management의節次問題도대폭개선하는방향으로이루어져야할것으로본다. 최근日本의경우도國家間의경쟁이치열해짐에따라金融,稅制面에서의리스크를補完하여企業의investment意愿을고취시키고民間企業에있어technology開發上제약이되는현행諸制度를修正개선하기위한具體的인시책을검토하고있으며이와같은產業technology開發政策을효과적으로추진하기위한새로운法規의制定까지도검토되고있다는사실은우리로서도앞으로있을稅制改編作業에크게참고가되어야할것으로본다.

## ① 技術開發準備金制度

半導體產業은技術集約의in产业으로指定되어所得金額의30/100,收入金額의15/1000에상당하는金額중많은金額을準備金으로積立한후 이를4年以内技術開發,導入技術의消化改良,技術情報,教育訓練,研究施設등技術開發促進法이정한바에따라사용하게되어있는同制度는이를이용하는業體數와積立金額및利用金額이계속증가하고있으나사용범위의限定과未使用分에대한加算稅등이부담이되고있고企業의입장에서볼때실질적인인센티브효과가強力하지못하다.

積立限度에있어서도IC의technology開發費가賣出額의14.6%線에이르는현실을감안할때부족한실정이므로稅制改編作業時半導體를비롯한技术集約产业에대해서는積立限度의확대,사용기간연장,사용범위확대및미사용金額에대한加算稅率의引下,수속절차의간소화등대폭적인개선이이루어지길기대한다.

## ② 半導體産業用設備耐用年數 단축

현행法人税法上半導體素子및관련製品製造用設備의耐用年數가6年으로되어있으나이는현실적으로적당하지못하다.技術의진보가빠르고製品의라이프사이클이4년이내로점점짧아지고있는현실에맞추어耐用年數는3년정도로단축되어야함이타당할것이다.

## ③ 半導體産業用設備에대한關稅減免

현행關稅法上半導體는技術主導產業으로지정되어70/100의關稅減免혜택을받고있어他產業의60/100에비해서는상대적으로높은혜택을받고있다고할수있으나방위산업체의90/100~100/100에비하면미진한면이있다.

방위산업용품의電子化가최근추세이고이의성능을좌우하는기본적인素子가半導體란점과현실적으로半導體素子製造用設備가아직은거의全量을輸入에의존할수밖에없다는점을감안하여100%免稅의혜택이주어져야할것으로본다.

## ④ 先進技術導入에대한稅制上支援

'84年度外資導入法을改正하여技術導入을자유화시켜先進技術導入을촉진시켜나가고있음은바람직한방향이다.이에추가하여첫째,技術用役導入또한外資導入法上의技術導入과동일법주로통합시켜技術用役導入代價의지불에대해서도租稅減免의혜택을부여하여先進技術用役導入를활성화시켜이를바탕으로우리의技術水準을향상시켜나가는것이바람직스럽다.둘째,外國人技術者에대한所得稅면제범위의확대가요망된다.현행租稅減免規制法上所得稅를면제받을수있는外國人の범위를6個月이상계속하여근무하는外國人으로제한되어있으나이를기간에관계없이근무하는外國人으로확대함으로써불필요한誘置期間의長期화를막고능력있는外國人技術者를필요에따라短期的으로유치하여企業의부담을줄이고실효를거둘수있다.세째,기술導入時先給技術料에대한早期償却認定技術導入契約에의해支拂하는技術料에는일반적으로先給技術料(Down Payment Royalty/Initial Royalty)와生産額또는賣出額에따라지불하는經常技術料(Running Royalty)로구분할수있다.

이때先給技術料는試驗研究費또는開發費의성질로法人税法上規程에따라當該事業年度부터5년이내매사업년도에均等額이상을償却함이타당함에도稅務當局에서는이를先給費用으로認定契約期間에평등하게損金插入토록요구하고있어빈번한技術導入이요청되는半導體產業으로서는큰부담이되고있다.綜合稅制改編作業時확실하게明文化되기바란다.

## ⑤ 租稅支援의綜合限度에대한例外措置

현행의 租稅支援施策들이 半導體를 비롯한 尖端技術企業들의 技術開發을 촉진시키는 실질적인 효과를 얻기 위해서는 이들 각종 支援策으로 인한 租稅支援額이 租稅減免規制法上의 租稅支援綜合限度에서例外措置가 이루어져야만 할 것이다.

### 3. 賢後 推進 課題

國富를 創出할 수 있는 高附加價值의 산업이며 또한 그 과급효과가 全產業에 크게 미치는 產業이라는 점 외에도 半導體產業은 物的資源이 빈약한 반면에 비교적 우수한 人的資源이 풍부한 우리나라의 현실에 가장 적합하고 가능성이 있는 분야로 이를 육성하기 위해서는 政府의 일관성 있는 강력한 政策과 과감한 投資가 이루어지지 않으면 안될 것이다. 이러한 觀點에서 본 下記의 주장이多少 현실과 맞지 않는 理想의 면이 있을지라도 이해있으시기 바란다.

#### 1) 半導體 共同研究事業의 推進

모든 技術開發은 後期 企業化 단계보다 初期研究段階의 리스크가 크며 半導體의 경우는 막대한 研究開發費가 소요된다. 그러기에 日本의 경우 일찌기 政府가 主管이 되어 半導體業界와 공동으로 VLSI開發에 총력을 기울여 대단한 성과를 올렸음은 이미 잘 알려진 사실이며 美國의 경우 또한 1979年부터 6個年 計劃으로 VHSIC라는 VLSI開發 등에 3億弗을 投入한 프로젝트에 IBM, TI 등 9個社가 공동 참여하고 있는 것으로 알려지고 있다. 물론 공동 研究事業은 각 企業의 利害關係가 틀려 어려운 점이 없는 바는 아니나 현재 설립되어 있는 韓國電子技術研究所를 중심으로 政府가 강력히主管하여 일부 財源

을 投資하고 각 企業 또한 공동으로 참여하여 적절한 프로젝트를 選定, 共同研究를 하는 것만이 半導體 침保護法案 등으로 점점 어려워지는 技術先進國과의 경쟁에서 우리 半導體產業이 살아갈 수 있는 길이라고 본다. 本共同研究에 대한 政府當局의 강력한 主導와 각 業體의 적극적인 참여가 요망된다.

#### 2) 半導體 開發 促進을 위한 特別法의 제정

1961年 5. 16 革命後 에너지問題 해결을 위해 石炭資源의 효율적인 개발과 투자의 촉진을 목적으로 「石炭開發臨時措置法」을 制定하여 開發會社에 대해서는 5年間法人稅, 營業稅, 所得稅를 전면 면제하여 줌으로써 큰 성과를 거둔 바 있다. 半導體產業의 획기적인 발전을 위한 投資의 促進과 효율적인 投資를 유도하기 위한 이와 같은 강력한 特別法의立法화 조치도 검토되어야 한다고 본다.

#### 3) 科學技術人力의 養成

短期的인 面에서의 技術人力의 養成에 대해서는 企業이 책임을 져야 되나 長期的인 側面에서의 科學技術人力의 養成과 需給에 대해서는 國家의 次元의 계획으로 추진되어야 할 것이다. 賢후 科學技術人力은 量的으로 그 需要가 加速化될 뿐만 아니라 質的인 面에서도一大轉換點을 맞게 될 것이다. 이를 위해서는 產業高度化 추세에 부응하여 長期需給展望을 기초로 한 人力養成 計劃下에 大學教育制度의 개선, 附設研究所의 확충, 博士課程 중심의 大學院 教育強化 등을 통한 基礎研究의 強化教育이 절실히 요망된다. 때마침 구성된 教育改革審議委員會에서도 教育制度 改編時 이 점에 각별히 유의하여 다루어 줄 것을 강조하고 싶다.

